

シリーズ最小のコンパクトコーター  
Smallest model in the series.

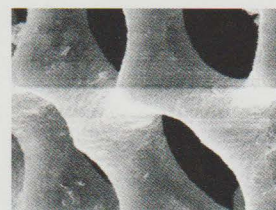
**COMPACT ION SPUTTER**

<Features>

- SEM用試料の前処理用として最適  
Suitable for fabricating samples for SEM



With Au coat



Without Au coat

- デバイスの電極膜付けにも使用可能  
Able to use as an electrode film coater for a device
- シンプル & イージーオペレーション  
Simple & Easy operation
- イオンダメージを軽減する間欠スパッタ機能を標準搭載  
Intermittent coating function reduces ion damage on the surface of sample.



Intermittent coat

normal coat

※ Sample : OHP Sheet, Current : 5mA

- 試料ブロックを用いて簡単にT-S間距離を変更可能  
T-S distance can be easily adjusted by using sample blocks.



DESK TOP QUICK COATER

SC-701MkII

## SC-701MkII 仕様 (SPECIFICATIONS)

ターゲットサイズ	49mm dia./ Au×1
試料台サイズ	50mm dia. (T-S間調節範囲 - 20, 30, 40mm)
排気操作	手動式
スパッタ方式	DC スパッタ/平行平板型
間欠スパッタ機構	Duty cycle 20%
高圧電源	1.2kV/ 0~9.9mA
到達圧力	5Pa
チャンバーサイズ	90(dia.)×90(depth)mm (SUS製)
タイマー	0~15min (最長30min)
ガス導入機構	ニードルバルブ 導入口径外径φ6mm ワンタッチ継手
排気装置	直結型ロータリーポンプ 20L/min (自動リーク付)
設置電源	単相 AC100V±10% 50/60Hz 7A
寸法・重量	本体 : 160(W)×326(D)×286(H)mm, 10kg RP : 295.5(W)×156(D)×199.5(H)mm, 9kg
オプションターゲット	Ag, Pt, Pd, Au-Pd, Pt-Pd

※本仕様は、性能改善のため予告なしに変更されることがあります。

Standard target	49mm dia./ Au×1
Sample base	50mm dia. (T-S adjustment range - 20, 30, 40mm)
Evacuation operation	Manual
Sputtering system	DC Sputtering / Parallel-plate type
intermitted sputtering model	Duty cycle 20%
High voltage power supply	1.2kV / 0~9.9mA
Degree of vacuum	5Pa
Chamber size	90 (dia.)×90 (depth) mm (SUS)
Timer	0~15min (Max.30min)
Gas regulating mechanism	Needle valve Inlet size 6mm dia.
Rotary pump	Directly-connected rotary pump 20L/min (with automatic leaking system)
Power supply	Single phase AC100V±10% 50/60Hz 7A
Dimensions and weight	Main unit : 160 (W)×326 (D)×286 (H) mm, 10kg RP : 295.5 (W)×156 (D)×199.5 (H) mm, 9kg
Option targets	Ag, Pt, Pd, Au-Pd, Pt-Pd

※These specifications may be changed without prior notice for the sake of improvement.

## 営業品目 / Lines of Business

### ■真空応用機器

- スパッタ装置  
Desk Top Quick Coater (2~8インチ用)  
RF/DCスパッタ装置
- 真空蒸着装置  
抵抗加熱タイプ  
EBタイプ
- 真空排気装置

### ■電子顕微鏡関連機器

- 電子線描画用パターン発生装置
- SEM用特殊ステージ  
試料加熱/引張試験ステージ  
描画用モーターステージ etc.
- SEM/TEM用マニピュレータ
- 3次元計測装置
- 立体画像観察装置 3D-SEM®
- 高精細画像取込装置

### ■その他、各種関連機器の試作・開発・製造・販売

### ■Vacuum applied equipment

- Sputter coater  
Desk Top Quick Coater (2~8inch)  
RF/DC Sputtering equipment
- Vacuum evaporation equipment  
Thermal resistance type  
Electron beam type
- Vacuum pumping down equipment

### ■Electron microscopic equipment

- Pattern generator for EB lithography
- Special stage for SEM  
Heating & tensile testing stage  
Motor stage for EB lithography etc.
- Manipulator for SEM/TEM
- 3 dimensional measurement device
- Stereo image observation device 3D-SEM®
- High resolution image capturing system

### ■Prototyping, development, manufacturing and sales of a variety of related equipment



このカタログは  
古紙配合率100%  
再生紙を使用しています。



このカタログは  
植物油インキで  
印刷しています。

## サンヨー電子株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-6  
TEL.03-3363-3551 FAX.03-3364-2892  
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>

## SANYU ELECTRON CO., LTD.

1-22-6, HYAKUNIN-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO, 169-0073, JAPAN  
TEL.81-3-3363-3551 FAX.81-3-3364-2892  
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>